## 順方向電流ストレスによる GaN p-n 接合の逆方向リーク電流の増加

Increase of reverse leakage current at GaN p-n junctions induced by forward current stress

豊田中研<sup>1</sup>, ミライズ・テクノロジーズ<sup>2</sup>, 名古屋大<sup>3</sup>, 豊田合成<sup>4</sup>

<sup>0</sup>成田 哲生<sup>1</sup>, 長里 喜隆<sup>2</sup>, 兼近 将一<sup>3</sup>, 近藤 健<sup>3</sup>, 上杉 勉<sup>3</sup>, 冨田 一義<sup>3</sup>,

池田 智史<sup>2</sup>, 山口 聡<sup>1</sup>, 木本 康司<sup>1</sup>, 小嵜 正芳<sup>4</sup>, 岡 徹<sup>4</sup>, 小島 淳<sup>3</sup>, 須田 淳<sup>3</sup>

Toyota CRDL.<sup>1</sup>, MIRISE Technologies<sup>2</sup>, Nagoya Univ.<sup>3</sup>, Toyoda Gosei<sup>4</sup>, <sup>°</sup>Tetsuo Narita<sup>1</sup>, Yoshitaka Nagasato<sup>2</sup>, Masakazu Kanechika<sup>3</sup>, Takeshi Kondo<sup>3</sup>, Tsutomu Uesugi<sup>3</sup>, Kazuyoshi Tomita<sup>3</sup>, Satoshi Ikeda<sup>2</sup>, Satoshi Yamaguchi<sup>1</sup>, Yasuji Kimoto<sup>1</sup>, Masayoshi Kosaki,<sup>4</sup> Tohru Oka,<sup>4</sup> Jun Kojima<sup>3</sup>, and Jun Suda<sup>3</sup>

E-mail: tetsuo-narita@mosk.tytlabs.co.jp

[目的] 逆方向電圧および順方向電流ストレスが GaN p-n 接合の電気特性に与える影響を調査した。 [方法] 有機金属気相成長法を用いて、自立 GaN 基板上に耐圧 219 Vの pn 接合層を積層した。脱水素 熱処理後、6~7°の極浅ベベルメサ終端構造[1]を用いて、接合直径 443 µm の円形ダイオード領域を 形成した。直径 320 µm の Ni/Au アノード電極、基板裏面にカソード電極を形成した。代表的な 3 素子 (#1DX、#2DX、#3DX と表記)の初期の順方向、25、100、175 ℃で逆方向電流-電圧特性を取得後、 以下の(1)~(4)の順にストレス試験を行った。(1) 耐圧の 80%までの逆方向電圧掃引を 25、100、175 ℃ で各 10 回。(2)耐圧の 80%電圧での逆バイアス保持を 25、100、175 ℃で各 1 時間。(3) 1 mA の定電流 で逆バイアス保持を 25、100、175 ℃で各 1 時間、(4) 25 ℃で 50、100、200、500 A cm<sup>2</sup>の順方向通電 を各 1 時間。(2)~(4)では各試験後に逆方向電流-電圧特性を取得し、ストレス前と比較した。 [結果] (1)~(3)の逆バイアス試験後において、逆方向電流-電圧特性の変化はなかった[2]。特に(3)はア バランシェ状態での保持試験に相当することから、GaN p-n 接合は逆バイアス温度ストレスに対して強 い耐性を有することが示された。一方で(4)の順方向通電ストレス試験後、1 素子(#2DX) においてリ ーク電流の増加がみられた。エミッション顕微鏡(EMS)で評価したところ、リーク電流は局所的に 流れていることが分かった。EMS の発光点は、X 線トポグラフィ像の転位コントラストの一つと一致

した[2]。逆方向リーク電流に変化のなかった素子#1DX、および劣化した素子#2DX の EMS の発光点 以外でも複数の転位コントラストを確認したことから[2]、順方向通電による GaN p-n 接合へのリーク 電流パスの形成は特定の貫通転位で起こることが示唆された。



